

740960-2026 - Състезателна процедура

Испания – Микроелектронни машини и уреди и микросистеми – **Suministro de sistema de litografía por escritura directa mediante láser (Direct Laser Writing, DLW)**

OJ S 207/2026 26/10/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Доставки

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Електронна поща: contratacion@upv.es

Правна категория на купувача: Публичноправна организация, контролирана от регионален орган

Дейност на възлагащия орган: Образование

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Suministro de sistema de litografía por escritura directa mediante láser (Direct Laser Writing, DLW)

Описание: El presente informe tiene por objeto justificar la necesidad e idoneidad de la contratación del suministro, instalación, puesta en marcha, validación y formación asociada a un sistema de litografía por escritura directa mediante láser (Direct Laser Writing, DLW), de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como en los preceptos concordantes que exigen la elaboración de un informe de insuficiencia de medios, necesidad e idoneidad del contrato con carácter previo al inicio del expediente de contratación. El equipo se destinará a la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) MICRONANOFABS, red española de salas blancas de micro y nanofabricación integrada en el Mapa Nacional de ICTS del Ministerio competente en materia de ciencia, de la que forma parte la Infraestructura de Micro y Nano Fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la Universitat Politècnica de València (UPV), junto con el Centro Nacional de Microelectrónica (CSIC) y la Central de Tecnología del ISOM (UPM). La instalación se ubicará en la Sala Blanca del edificio 8F del NTC-UPV. El Centro de Tecnología Nanofotónica desarrolla actividades de investigación y fabricación en los ámbitos de la fotónica integrada, la nanotecnología, la biosensórica, la microóptica y los sistemas microfluídicos. Entre los dispositivos que se fabrican de forma habitual se incluyen circuitos fotónicos integrados (PICs), biosensores fotónicos, nanoantenas, resonadores ópticos, cristales fotónicos, elementos ópticos difractivos, metalentes y microlentes, estructuras tridimensionales obtenidas mediante litografía Gray Scale, dispositivos MEMS, sistemas microfluídicos, y encapsulados y componentes híbridos fotónicos. Estos dispositivos requieren combinar procesos de fabricación con resoluciones nanométricas y micrométricas, elevados niveles de precisión geométrica, alineamiento multicapa y una elevada productividad que permita fabricar dispositivos completos y obleas en tiempos compatibles con la actividad investigadora y la prestación de servicios tecnológicos. Por ello, es necesaria la adquisición de un sistema de litografía que ofrezca simultáneamente una elevada resolución, gran

velocidad de escritura, estabilidad mecánica, precisión de posicionamiento y versatilidad para trabajar sobre una amplia variedad de materiales y tamaños de sustrato. Como ICTS integrada en la red MICRONANOFABS, el NTC-UPV presta servicios de micro y nanofabricación a grupos de investigación nacionales e internacionales, así como a empresas, en el marco de proyectos competitivos, contratos de transferencia tecnológica y prestación de servicios avanzados. El equipo formará parte de la infraestructura científica del centro y será utilizado para el desarrollo de proyectos de investigación nacionales e internacionales, contratos de transferencia tecnológica con empresas y prestación de servicios de fabricación a usuarios internos y externos. Esta condición de infraestructura singular de uso compartido obliga a mantener una dotación instrumental actualizada, robusta y de prestaciones acordes al estado del arte, en línea con los objetivos del PERTE Chip para el fortalecimiento de las capacidades nacionales de microelectrónica y fotónica La contratación resulta, por tanto, necesaria para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la ICTS MICRONANOFABS-NTC, no existiendo medios propios adecuados, suficientes y disponibles para atender esta necesidad, en los términos exigidos por el artículo 28 LCSP

Идентификатор на процедурата: 9fb4f2d3-a537-4e86-97a2-a8cab95192c6

Вътрешен идентификатор: MY26/ICTS/S/88

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: да

Обосновка на ускорената процедура: La adjudicación, formalización y ejecución del contrato debe llevarse a cabo en el plazo máximo de ejecución fijado por la Generalitat Valenciana, Plan Endavant, que es el 31 de diciembre de 2026. Que la disponibilidad de los fondos para llevar a cabo la presente contratación no se ha producido hasta el 11 de septiembre de 2026. Que los plazos y requisitos ordinarios de tramitación del expediente de contratación resultan impracticables para poder cumplir el plazo máximo de ejecución previsto. Siendo necesario e inaplazable atender la formalización del contrato objeto del presente expediente y acelerar la adjudicación por razones de interés público.

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 31712000 Микроелектронни машини и уреди и микросистеми

2.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Valencia / València (ES523)

Държава: Испания

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 465 000,00 EUR

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Уведомление

Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за възлагане на обществена поръчка: Conflicto de intereses debido a que el licitador haya participado en el procedimiento de contratación objeto de este contrato.

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0000

Заглавие: Suministro de sistema de litografía por escritura directa mediante láser (Direct Laser Writing, DLW)

Descripción: El presente informe tiene por objeto justificar la necesidad e idoneidad de la contratación del suministro, instalación, puesta en marcha, validación y formación asociada a un sistema de litografía por escritura directa mediante láser (Direct Laser Writing, DLW), de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como en los preceptos concordantes que exigen la elaboración de un informe de insuficiencia de medios, necesidad e idoneidad del contrato con carácter previo al inicio del expediente de contratación. El equipo se destinará a la Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) MICRONANOFABS, red española de salas blancas de micro y nanofabricación integrada en el Mapa Nacional de ICTS del Ministerio competente en materia de ciencia, de la que forma parte la Infraestructura de Micro y Nano Fabricación del Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC) de la Universitat Politècnica de València (UPV), junto con el Centro Nacional de Microelectrónica (CSIC) y la Central de Tecnología del ISOM (UPM). La instalación se ubicará en la Sala Blanca del edificio 8F del NTC-UPV. El Centro de Tecnología Nanofotónica desarrolla actividades de investigación y fabricación en los ámbitos de la fotónica integrada, la nanotecnología, la biosensórica, la microóptica y los sistemas microfluídicos. Entre los dispositivos que se fabrican de forma habitual se incluyen circuitos fotónicos integrados (PICs), biosensores fotónicos, nanoantenas, resonadores ópticos, cristales fotónicos, elementos ópticos difractivos, metalentes y microlentes, estructuras tridimensionales obtenidas mediante litografía Gray Scale, dispositivos MEMS, sistemas microfluídicos, y encapsulados y componentes híbridos fotónicos. Estos dispositivos requieren combinar procesos de fabricación con resoluciones nanométricas y micrométricas, elevados niveles de precisión geométrica, alineamiento multicapa y una elevada productividad que permita fabricar dispositivos completos y obleas en tiempos compatibles con la actividad investigadora y la prestación de servicios tecnológicos. Por ello, es necesaria la adquisición de un sistema de litografía que ofrezca simultáneamente una elevada resolución, gran velocidad de escritura, estabilidad mecánica, precisión de posicionamiento y versatilidad para trabajar sobre una amplia variedad de materiales y tamaños de sustrato. Como ICTS integrada en la red MICRONANOFABS, el NTC-UPV presta servicios de micro y nanofabricación a grupos de investigación nacionales e internacionales, así como a empresas, en el marco de proyectos competitivos, contratos de transferencia tecnológica y prestación de servicios avanzados. El equipo formará parte de la infraestructura científica del centro y será utilizado para el desarrollo de proyectos de investigación nacionales e internacionales, contratos de transferencia tecnológica con empresas y prestación de servicios de fabricación a usuarios internos y externos. Esta condición de infraestructura singular de uso compartido obliga a mantener una dotación instrumental actualizada, robusta y de prestaciones acordes al estado del arte, en línea con los objetivos del PERTE Chip para el fortalecimiento de las capacidades nacionales de microelectrónica y fotónica. La contratación resulta, por tanto, necesaria para el cumplimiento y realización de los fines institucionales de la ICTS MICRONANOFABS-NTC, no existiendo medios propios adecuados, suficientes y disponibles para atender esta necesidad, en los términos exigidos por el artículo 28 LCSP.

Вътрешен идентификатор: MY26/ICTS/S/88

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cprv): 31712000 Микроелектронни машини и уреди и микросистеми

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Valencia / València (ES523)

Държава: Испания

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 15 Дни

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП) : не

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

Подход за намаляване на въздействието върху околната среда: Друго

Социална цел, чието постигане се насърчава: Друго

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Общ годишен оборот

Описание на критерия за подбор: Cifra anual de negocio

Критерий: Референции за определени доставки

Описание на критерия за подбор: Trabajos realizados

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Oferta económica.

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 100

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=xOYbjLwFiJwS7pcxhTeWOg%3D%3D

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: испански

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 10/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00)
централноевропейско време, западноевропейско лятно време
Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 15 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 11/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) централноевропейско време,
западноевропейско лятно време

Място: Sala Centro. Edificio Rectorado 1ª planta. Universitat Politècnica de València.

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване
на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: Ver apartado 27 del cuadro de
características..

Електронно фактуриране: Разрешено

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: не

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Rectorado de la
Universitat Politècnica de València - Universitat Politècnica de València

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Advertir a los interesados que el presente acto pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano jurisdiccional competente de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Valenciana, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente Resolución. No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta resolución un recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Administrativo anteriormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta de recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y sig. de la ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 2 de octubre de 2015). En los casos previstos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, advertir a los interesados que esta resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso especial en materia de contratación regulado en dicho artículo, ante el órgano de contratación de la Universitat Politècnica de València. El plazo de interposición será de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. En los supuestos de financiación por la U.E. (Fondos NEXT GENERATION), el plazo de interposición del recurso especial en materia de contratación, cuando proceda, será de 10 días naturales y se computará en la forma establecida en el artículo 50.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
: Rectorado de la Universitat Politècnica de València - Servicio de Cotratación. Edificio
Rectorado de la Universitat Politècnica de València

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Регистрационен номер: 40000260000071

Регистрационен номер: Q4618002B

Град: Valencia

Пощенски код: 46022

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Valencia / València (ES523)

Държава: Испания

Звено за контакт: Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Електронна поща: contratacion@upv.es

Телефон: 963877406

Интернет адрес: <http://www.upv.es>

Профил на купувача: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zIBD30X0P3g%3D>

Други звена за контакт:

Официално наименование: Servicio de Cotratación. Edificio Rectorado de la Universitat Politècnica de València

Град: Valencia

Пощенски код: 46022

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Madrid (ES300)

Държава: Испания

Електронна поща: contratacion@upv.es

Телефон: +34 963877406

Интернет адрес: <http://www.upv.es/entidades/CYO/>

Други звена за контакт:

Официално наименование: Universitat Politècnica de València

Град: Valencia

Пощенски код: 46022

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Valencia / València (ES523)

Държава: Испания

Интернет адрес: <http://www.upv.es/entidades/CYO/>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 1f2a5874-4d04-478d-8a36-172e9010dce3 - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 23/10/2026 12:47:44 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: испански

Номер на публикуване на обявлението: 740960-2026

Номер на броя на ОВ S: 207/2026

